

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2023-022

有研半导体硅材料股份公司

关于补选董事、监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会收到董事本乡邦夫先生、铃木正行先生、张汝京先生的书面辞职报告，公司监事会收到监事小塚充宏先生的书面辞职报告。具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号：2023-020）。

一、补选非独立董事

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东株式会社RS Technologies提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选远藤智先生、古头泰则先生为公司第一届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司于2023年7月6日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：经审阅本次增补的第一届董事会非独立董事候选人的履历资料，被提名人远藤智先生、古头泰则先生符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定

不得担任公司董事的情形。董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东合法利益的情形。

综上，同意提名远藤智先生、古头泰则先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

二、 补选独立董事

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东株式会社RS Technologies提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选孙根志华先生为公司第一届董事会独立董事（简历详见附件）。公司于2023年7月6日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

截至本公告披露日，孙根志华先生尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。孙根志华先生作为公司第一届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。若公司股东大会审议通过孙根志华先生当选独立董事，届时孙根志华先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事认为：经审阅本次增补的独立董事候选人孙根志华先生的简历等相关资料，被提名人孙根志华先生符合上市公司独立董事任职资格的规定，候选人的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任独立董事的职责要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求，公司本次独立董事候选人的提名及审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东合法利益的情形。若公司股东大会审议通过孙根志华先生当选独立董事，届时孙根志华先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员职务，任期自公司

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

综上，同意提名孙根志华先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

三、 补选非职工监事

为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年7月6日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工监事的议案》，同意补选田中利朗先生为公司第一届监事会非职工监事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：远藤智先生、古头泰则先生、孙根志华先生、田中利朗先生简历

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023年7月7日

附件

1、远藤智先生简历

远藤智先生，出生于1971年3月，日本国籍，毕业于国立一关工业高等专科学校。1991年4月至2010年12月任职于RASA工业株式会社；2011年1月至2017年3月任株式会社RS Technologies制造部部长；2017年4月至今任株式会社RS Technologies制造部部长、公司董事。

截至本报告披露日，远藤智先生未直接持公司股票。由于远藤智先生目前在控股股东株式会社RS Technologies任职，因此，与公司控股股东株式会社RS Technologies存在关联关系。远藤智先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2、古头泰则先生简历

古头泰则先生，出生于1964年2月，日本国籍，大学学历。2011年1月至今历任株式会社RS Technologies品质保证部部长、高级执行总监；2014年10月至2020年8月任台湾艾尔斯半导体股份有限公司总经理；2020年9月至今任山东有研艾斯半导体材料有限公司技术总监。

截至本报告披露日，古头泰则先生未直接持公司股票。由于古头泰则先生目前在控股股东株式会社RS Technologies任职，因此，与公司控股股东株式会社RS Technologies存在关联关系。古头泰则先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3、孙根志华先生简历

孙根志华先生，出生于1962年10月，日本国籍，博士学历，获明治大学经济学博士。1996年4月至今曾先后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授。

截至本报告披露日，孙根志华先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4、田中利朗先生简历

田中利朗先生，出生于1970年6月，日本国籍，大学学历。1993年4月至2022年10月任职于三菱日联银行；2022年11月至今任株式会社RS Technologies经营企划室主管。

截至本报告披露日，田中利朗先生未直接持有公司股票。由于田中利朗先生目前在控股股东株式会社RS Technologies任职，因此，与公司控股股东株式会社RS Technologies存在关联关系。田中利朗先生与本公司其他持有5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。